



# Vilniaus universiteto FTM APC



## PUSLAIDININKIŲ TECHNOLOGIJŲ IR CHARAKTERIZAVIMO ATVIROS PRIEIGOS CENTRO IŠTEKLIŲ IR TEIKIAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

### **Ištekliai:**

1. Kristalinių sluoksnių epitaksijos iš metalo-organinių medžiagų garų fazės reaktorius (MOCVD arba MOVPE) (A. Kadys);
2. Skenuojantis elektroninis mikroskopas (SEM) su rentgeno spindulių energijos dispersijos (EDX) ir elektroninio spindulio indukuotų srovių (EBIC) matavimo priedais (A. Kadys);
3. Jonų reakcinio ėsdinimo įrenginys (I. Reklaitis);
4. Greito termino atkaitinimo krosnis (I. Reklaitis);
5. Optinio polinimo standas (R. Tomašiūnas);
6. 4-ių sondų varžos matavimo ir puslaidininkinio kristalo laidumo tipo nustatymo prietaisas (V. Bikbajevs)
7. Ecopia HMS-3000 Holo matavimų įranga (V. Bikbajevs)
8. Šlifavimo ir poliravimo įrenginys Struers LaBoPol – 1 (I. Reklaitis);
9. NIR spektrometras su CCD kamera ir priedais, spektrinis diapazonas 0,8-2,2  $\mu\text{m}$  (J. Mickevičius)
10. Daugiakanalė spektroskopijos analizės įranga, spektrinis diapazonas 200-850 nm, kompleksas (J. Mickevičius);
11. Radiacinių defektų tankio dozimetrijos įrenginys VUTEG-5 hadronų apšvitoms kontroliuoti (E. Gaubas);
12. Fotojonizacinės spektroskopijos VU gamybos įrenginys (E. Gaubas);
13. Volt-amperinių ir volt-faradinių charakteristikų temperatūrinių kitimų matavimo įranga (E. Gaubas);
14. BELIV-VU (E. Gaubas);
15. HERA – DLTS System FT 1030 spektrometras (E. Gaubas);
16. Rekombinacijos parametrų technologinės kaitos tyrimų, planarinio bei sluoksninio skenavimo daugiafunkcinis įrenginys VUTEG-4 (E. Gaubas);
17. Radiacinių defektų evoliucijos ir rekombinacijos parametrų kaitos in situ matavimų, apšvitinant aukštųjų energijų dalelėmis, įrenginys VUTEG-3 (E. Gaubas);
18. Daugiafunkcinė mikroskopijos sistema: atominės jėgos mikroskopas (AFM), konfokalinis mikroskopas ir artimojo lauko optinis mikroskopas (SNOM) (G. Tamulaitis)
19. Sužadinimo-zondavimo ir dinaminių difrakcinių gardelių matavimų standas (R. Aleksiejūnas)

### **Paslaugos:**

1. III grupės nitritinių puslaidininkinių darinių epitaksija MOCVD metodu (A. Kadys);
2. Kietų medžiagų paviršių tyrimai skenuojančiu elektroniniu mikroskopu (SEM) (A. Kadys);
3. Kietų medžiagų cheminė mikroanalizė skenuojančiu elektroniniu mikroskopu su EDS/EDX priedėliu (A. Kadys);
4. p-n sandūrų ir puslaidininkinių medžiagų paviršių tyrimai skenuojančiu elektroniniu mikroskopu su EBIC priedėliu (A. Kadys);
5. Varžos matavimas keturių sondų metodu (V. Bikbajevs)
6. Bandinių charakterizavimas Holo metodu (V. Bikbajevs)
7. Puslaidininkinių struktūrų ėsdinimas sausuoju būdu (I. Reklaitis)
8. Spartus medžiagų atkaitinimas 0 – 1200 °C (I. Reklaitis)
9. Medžiagų poliravimas (I. Reklaitis)
10. Molekulių optinio polinimo tyrimas (R. Tomašiūnas)



# Vilniaus universiteto

## FTM APC



11. Didelių radiacinių apšvitų aplinkos dozimetrinis monitoringas (E. Gaubas);
12. Giliųjų centrų foto-jonizacinė spektroskopija (E. Gaubas);
13. Volt-amperinių ir volt-faradinių charakteristikų temperatūrinių kitimų kombinuoti tyrimai sandūrų darinių funkciniais parametrais įvertinti (E. Gaubas);
14. Sandūrų barjero parametrų kitimų Si, Ge, GaAs, GaN, Cu-CdS ir foto-elektros puslaidininkinių prietaisų tyrimai (E. Gaubas);
15. Sandūrų barjero parametrų kitimų Si, Ge, GaAs, GaN, Cu-CdS ir foto-elektros puslaidininkinių prietaisų tyrimai, keičiant temperatūrą (E. Gaubas);
16. Giliųjų lygmenų, suformuojamų technologinėmis procedūromis, spektro kitimų tyrimai (E. Gaubas);
17. Puslaidininkinių medžiagų krūvininkų gyvavimo trukmių matavimai skersinės ir planarinės žvalgos būdais (E. Gaubas);
18. Puslaidininkinių medžiagų krūvininkų gyvavimo trukmių matavimai (E. Gaubas);
19. Radiacinių defektų evoliucijos ir rekombinacijos parametrų kaitos in situ matavimai, apšvitinant aukštųjų energijų dalelėmis (E. Gaubas);
20. Paviršiaus morfologijos matavimas atominės jėgos mikroskopu (AFM) (G. Tamulaitis)
21. Erdviškai išskirtos liuminescencijos matavimai konfokaliniu mikroskopu (G. Tamulaitis)
22. Erdviškai išskirtos liuminescencijos matavimai artimojo lauko skenuojančiuoju optiniu mikroskopu (SNOM) (G. Tamulaitis)
23. Liuminescencijos matavimai stacionariomis ir kvazistacionariomis sąlygomis NIR spektro ruože (J. Mickevičius)
24. Liuminescencijos matavimai stacionariomis ir kvazistacionariomis sąlygomis ir su nanosekundine laikine skyra UV-VIS spektro ruože (J. Mickevičius)
25. Bekontaktis krūvio nešėjų gyvavimo trukmės ir difuzijos koeficiento nustatymas puslaidininkiuose ir jų dariniuose (R. Aleksiejūnas)